

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 26 年 4 月 3 日 (2014.4.3)

【公開番号】特開 2012-169534 (P2012-169534A)
 【公開日】平成 24 年 9 月 6 日 (2012.9.6)
 【年通号数】公開・登録公報 2012-035
 【出願番号】特願 2011-30909 (P2011-30909)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/677 (2006.01)

H 0 1 L 21/31 (2006.01)

C 2 3 C 16/44 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/68 A

H 0 1 L 21/31 B

C 2 3 C 16/44 F

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 2 月 13 日 (2014.2.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板処理装置本体と、
 基板を搬送する搬送手段を備え、前記基板処理装置本体に基板を搬入出する搬入出部と、
 前記基板処理装置本体内部において基板を移送する移送装置と、
 前記搬入出部と前記移送装置とを離間させるようにして設けられ、前記基板処理装置本体内部に搬入された基板を収納する収納部と、を有し、
 前記搬送手段は、前記移送装置に向けて伸縮する伸縮部と、
 前記伸縮部の伸縮動作に伴って、当該伸縮部の伸縮する長さよりも大きくなるように基板を移動させる移動部と、
 を有する基板処理装置。

【請求項 2】

前記搬送手段は、前記基板が収容される基板収容器を載置する載置部をさらに備え、
前記載置部を前記基板処理装置本体外部に位置する搬入出位置と、前記基板処理装置本体内部に位置する受渡位置の間で搬送する請求項 1 に記載の基板処理装置。

【請求項 3】

前記載置部が移動する長さは、前記伸縮部の延伸する長さの 2 倍となる請求項 2 に記載の基板処理装置。

【請求項 4】

前記搬送手段は、前記伸縮部に接続される第 1 の移動部と、
前記第 1 の移動部の上部に設けられた第 2 の移動部とをさらに備え、
前記第 2 の移動部の移動する長さは前記第 1 の移動部の移動する長さの 2 倍となる請求項 1 から 3 に記載の基板処理装置。

【請求項 5】

前記基板処理装置は、前記搬送装置を旋回自在とする旋回部をさらに備える請求項 1 から 4 に記載の基板処理装置。

【請求項 6】

伸縮部の伸縮する長さよりも大きくなるように基板を移動させ、基板処理装置本体に当該基板を搬入出する工程と、
前記基板処理装置本体内において基板を移送する工程と、
基板を搬入出する搬入出部と基板を移送する移送装置とを離間させるようにして設けられた収納部に基板を収納する工程と、
を有する半導体装置の製造方法。